

平成31年度 ナノテクキャリアアップアライアンス  
京都大学 圧電デバイスコース

■目的、対象者：

圧電デバイスは、携帯電話やカーナビゲーション等に搭載されているジャイロセンサやインクジェットプリンターの液滴吐出機構などに幅広く応用されています。圧電材料としてはジルコン・チタン酸鉛 ( $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ ) (通称：PZT) が幅広く応用されてきました。本コースでは、圧電デバイス初心者を対象に3日間に亘って、圧電材料の基礎、圧電薄膜形成、デバイス化に関する講義およびスパッタ装置によるPZT成膜を実施し、その薄膜の結晶構造解析、圧電特性を調べることにより圧電薄膜の基本技術習得を目指します。

■募集人数： 3名

■期間： 平成31年 9月11日(水)、12日(木)、13日(金) 実習：3日間

■会場：

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス内 工学部物理系校舎3階327号

<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

■内容：

1日目 9月11日(水)

- ① 全体スケジュール説明、安全教育
- ② スパッタ装置によるPZT成膜 (成膜の待ち時間内に講義)

2日目 9月12日(木)

- ③ X線回折装置による結晶構造解析
- ④ SEMによる薄膜構造観察
- ⑤ 上部電極形成(真空蒸着装置)

3日目 9月13日(金)

- ⑥ 強誘電体評価システムによるPEループ測定
- ⑦ データ整理およびまとめ

■受講料： 10,500円

■問合せ・申込先：

京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室内 CUPAL 事務局

( [cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp](mailto:cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp)、電話：075-383-3693 )